УДК 681.2:621.3.082.1

ТАРАНЕНКО Ю.К., канд. техн. наук, Днепропетровский университет экономики и права

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ВИБРАЦИОННЫХ ПЛОТНОМЕРОВ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РЕЗОНАТОРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

У статті розглянута методика розрахунку вібраційних густиномірів рідини і газу, з використанням циліндричних резонаторів. Методика дозволяє виключити додаткові датчики температури та тиску, подавати контрольоване середовище тільки у внутрішню порожнину двох циліндричних резонаторів датчика густини, виключити демпфірування коливань у зазорах систем збудження коливань циліндрів.

1. Анализ существующих проблем виброчастотных методов контроля плотности жидкости и газа

Среди средств аналитического контроля автоматические плотномеры жидкостей и газов занимают особое место. Состав любого газа или низковязкой жидкости характеризуется плотностью или удельным весом. Непрерывный и точный мониторинг плотности или зависящих от плотности переменных будет определять любые изменения компонентов процесса или качество финального продукта в режиме реального времени, что позволяет повысить производительность, минимизировать отходы и снизить издержки по сравнению с методом отбора проб [1]. Весьма важным является измерение плотности жидких и газообразных веществ, при их количественном учете в единицах массы. Массовый расход определяется по показаниям плотномера и объёмного расходомера.

Широкому промышленному использованию плотномеров препятствует их несовершенство, связанное с низкими метрологическими показателями, трудоёмкостью монтажа и обслуживания, большими габаритами и массой, низкой надёжностью. Возрастающие требования к совершенству средств измерения заставляют исследователей искать новые методы измерения, одним из которых является виброчастотный [2]. Виброчастотные плотномеры преобразуют измеряемый параметр в частотно - модулированный выходной сигнал без промежуточных преобразователей, что обеспечивает высокую точность измерения в нормальных условиях эксплуатации.

Изменение температуры контролируемой среды приводит к существенным погрешностям контроля плотности виброчастотными методами. Например, для резонаторов изготовленных из нержавеющей стали X18H10T, чувствительность к температуре превышает чувствительность к основному контролируемому параметру – плотности. Существенное влияние на показания виброчастотных плотномеров оказывает давления и скорость течения среды через датчик. Поэтому все серийно выпускаемые виброчастотные снабжены датчиками температуры, плотномеры установленными в местах подвода и вывода из резонатора жидкости или газа, а некоторые и датчиком давления [3]. Виброчастотные плотномеры с цилиндрическим резонатором отличаются высокой чувствительностью. поэтому используются как для измерения плотности жидкостей, так и для измерения плотности газов и газовых смесей. Такие плотномеры снабжены дополнительным датчиком температуры в виде термопары или термометра сопротивления, а компенсация влияния давления осуществляется путём подачи измеряемой среды, как со стороны наружной, так и со стороны внутренней поверхности цилиндра [4]. При таком методе построения виброчастотных плотномеров возникает две следующие проблемы, ограничивающие область применения метода в целом. Первая, состоит в инерционности температурной коррекции связанной с постоянной времени датчика температуры. Вторая, в демпфировании колебаний цилиндра в зазорах системы возбуждения колебаний, что снижает добротность резонатора, а следовательно точность измерения плотности жидкости или газа.

Решением проблемы является изобретённый автором способ измерения плотности, который предусматривает дифференциальное включение двух механических резонаторов с разной чувствительностью к измеряемой плотности жидкости или газа и близкими чувствительностями к температуре и давлению [5].

Вибрационные плотномеры, построенные на основе дифференциального метода, не требуют дополнительных датчиков температуры и давления, практически инвариантны к изменениям указанных параметров. Однако методика расчёта конструктивных параметров виброчастотных плотномеров на основе цилиндрических резонаторов до настоящего времени не была разработана.

2. Определение условий инвариантности к колебаниям температуры контролируемой среды

В работе [6] автором получены соотношения для функции измерительного преобразования плотности жидкости или газа в разностную частоту цилиндрических резонаторов дифференциального датчика

$$\begin{aligned} f_{II} &= f_{1} - f_{2} \\ f_{1} &= \frac{\lambda_{1}}{L_{1}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{G_{A}}{m_{IIA} + m_{IIPA}}} \cdot \sqrt{1 + \frac{L_{1}^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot \lambda_{1}^{2} \cdot G_{A}} \cdot \left[\pi^{2} \cdot N_{Z}^{1} + 4 \cdot k_{IIA}^{2} \cdot N_{S}^{1}\right]} \\ f_{2} &= \frac{\lambda_{2}}{L_{2}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{G_{B}}{m_{IIB} + m_{IIPB}}} \cdot \sqrt{1 + \frac{L_{2}^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot \lambda_{2}^{2} \cdot G_{B}} \cdot \left[\pi^{2} \cdot N_{Z}^{2} + 4 \cdot k_{IIB}^{2} \cdot N_{S}^{2}\right]} \end{aligned}$$
(1)

 $f_{\rm A}-$ выходной частотный сигнал дифференциального датчика, $f_1, f_2 -$ частоты колебаний резонаторов в жидкости или газе, L_1 , $L_2 - длины цилиндров; <math display="inline">a_1$, a_2 - внутренние радиусы сечения цилиндров, h_1 , h_2 - толщина стенок цилиндров, $G_A = E_A \cdot h_1^3 / 12 \cdot (1 - \mu^2)$, $G_B = E_B \cdot h_2^3 / 12 \cdot (1 - \mu^2) - цилиндрические жёсткости резонаторов, <math display="inline">E_A$, E_B - модули упругости материала цилиндров; μ - коэффициент Пуассона, $k_{IIA} = L_1 / a_1$, $k_{IIB} = L_2 / a_2$ - относительная длина резонаторов; $k_{AA} = h_1 / a_1$, $k_{AB} = h_2 / a_2 -$ относительная толщина стенки резонаторов, $m_{IIA} = \rho_{IIA} \cdot h_1$, $m_{IIB} = \rho_{IIB} \cdot h_2 -$ массы единицы площади поверхности резонаторов; ρ_{IIA} , ρ_{IIB} - плотность материала резонаторов, $m_{IIPA} = K_{PA} \cdot \rho_P \cdot a_1$, $m_{IIPB} = K_{PB} \cdot \rho_P \cdot a_2 -$ "присоединённые" массы жидкости или газа; ρ_P - плотность контролируемой среды; N_Z^1 , N_S^1 , N_Z^2 , N_S^2 – усилия действующие в осевом z и в окружном s направлениях к срединной поверхности цилиндров.

Следует отметить, что соотношения (1) получены на основе известного в теории колебаний допущения о том, что при перемещении колеблющегося упругого тела из вакуума в жидкость или газ форма его колебаний не меняется, а воздействие среды на частоту его колебаний подобно действию некой "присоединённой массы", добавляемой к собственной массе упругого тела.

Из системы (1) следует, что чувствительность дифференциального датчика зависит от относительной толщины K_p слоя "присоединённой массы" контролируемой среды. Экспериментальные и теоретические исследования по определению K_p в зависимости от свойств жидкости, размеров цилиндра и корпуса, в котором он установлен, частоты колебаний цилиндра [7], позволяют сделать следующие выводы для дифференциального датчика:

1. Для размещения двух резонаторов в общем корпусе расстояния между внутренними краями резонаторов должно быть больше двух их

граничных размеров (удвоенной величины большего из диаметров срединной поверхности цилиндров);

2. Величина К_р в рабочем диапазоне частот колебаний остается постоянной и находится в пределах 0,2÷0,22.

Величина K_p для цилиндрического резонатора выбранной формы определяется экспериментально по следующей методике. Измеряя частоты резонаторов $f_1(\rho_1)$, $f_1(\rho_2)$, $f_2(\rho_1)$, $f_2(\rho_2)$ в жидкостях или газах с известными плотностями ρ_1 , ρ_2 , при нормальных условиях, без учёта влияния избыточного давления $N_Z^1 = N_S^1 = N_Z^2 = N_S^2 = 0$, можно, используя систему (1) составить следующую систему уравнений.

$$\begin{array}{l} f_{1}(\rho_{1}) = f_{01} \cdot \sqrt{\frac{h_{1} \cdot \rho_{IIA}}{h_{1} \cdot \rho_{IIA} + a_{1} \cdot K_{PA} \cdot \rho_{1}}}, f_{1}(\rho_{2}) = f_{01} \cdot \sqrt{\frac{h_{1} \cdot \rho_{IIA}}{h_{1} \cdot \rho_{IIA} + a \cdot K_{PA} \cdot \rho_{2}}} \\ f_{2}(\rho_{1}) = f_{02} \cdot \sqrt{\frac{h_{2} \cdot \rho_{IIB}}{h_{2} \cdot \rho_{IIB} + a_{2} \cdot K_{PB} \cdot \rho_{1}}}, f_{2}(\rho_{2}) = f_{02} \cdot \sqrt{\frac{h_{2} \cdot \rho_{IIB}}{h_{2} \cdot \rho_{IIB} + a_{2} \cdot K_{PB} \cdot \rho_{2}}} \end{array} \right\}$$
(2)
где $f_{01} = \frac{0,303 \cdot \lambda_{1} \cdot h_{1}}{L_{1}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{A}}{\rho_{IIA}}}, f_{02} = \frac{0,303 \cdot \lambda_{2} \cdot h_{2}}{L_{2}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{B}}{\rho_{IIB}}} -$ начальные

частоты цилиндрических резонаторов.

Значение относительных толщин "присоединённой массы" контролируемой среды К_{РА}, К_{РВ} определяются из соотношений, полученных из системы (2).

$$K_{PA} = \frac{h_{1} \cdot \rho_{IIA}}{a_{1} \cdot (\rho_{1} - \rho_{2})} \cdot \left[\left(\frac{f_{01}}{f_{1}(\rho_{1})} \right)^{2} - \left(\frac{f_{01}}{f_{1}(\rho_{2})} \right)^{2} \right],$$

$$K_{PB} = \frac{h_{2} \cdot \rho_{IIB}}{a_{2} \cdot (\rho_{1} - \rho_{2})} \cdot \left[\left(\frac{f_{02}}{f_{2}(\rho_{1})} \right)^{2} - \left(\frac{f_{02}}{f_{2}(\rho_{2})} \right)^{2} \right] \right].$$
(3)

Влияние температуры на параметры резонаторов можно учесть при помощи следующих соотношений: $a_1 = a_1 \cdot (1 + \alpha_1 \cdot \Delta t)$, $a_2 = a_2 \cdot (1 + \alpha_2 \cdot \Delta t)$, $h_1 = h_1 \cdot (1 + \alpha_1 \cdot \Delta t)$, $h_2 = h_2 \cdot (1 + \alpha_2 \cdot \Delta t)$, $E_A = E_A \cdot (1 - \beta_{EA} \cdot \Delta t)$, $E_B = E_B \cdot (1 - \beta_{EB} \cdot \Delta t)$, $\rho_{ILA} = \rho_{ILA} \cdot (1 - 3 \cdot \alpha_1 \cdot \Delta t)$, $\rho_{ILB} = \rho_{ILB} \cdot (1 - 3 \cdot \alpha_2 \cdot \Delta t)$, $\rho_P = \rho_P \cdot (1 - \beta_V \cdot \Delta t)$, где: α_1, α_2 — температурные коэффициенты линейного расширения материала резонаторов (°C⁻¹); β_{EA} , β_{EB} – температурные коэффициенты модуля упругости материала резонаторов (°C⁻¹); β_V –

коэффициент объемного расширения контролируемой среды (°C⁻¹). $\Delta t = t - t_0$ – отклонение температуры от $t_0 = 20$ °C (Для упрощения записи, верхние индексы t и t_0 при параметрах a_1 , a_2 , h_1 , h_2 , E_A , E_B , ρ_{IIA} , ρ_{IIB} , ρ_P пропущены).

Перепишем систему (1), с учётом приведенных температурных зависимостей.

$$\begin{aligned} f_{\mathcal{A}} &= f_{1}(\rho_{P}) - f_{2}(\rho_{P}) - \\ &- \left[f_{1}(\rho_{P}) \cdot \varphi_{A} - f_{2}(\rho_{P}) \cdot \varphi_{B} \right] \cdot \Delta t \\ f_{1}(\rho_{P}) &= \frac{0,303 \cdot \lambda_{1} \cdot h_{1}}{L_{1}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{A} \cdot h_{1}}{h_{1} \cdot \rho_{IIA} + a_{1} \cdot K_{PA} \cdot \rho_{P}}} \\ f_{2}(\rho_{P}) &= \frac{0,303 \cdot \lambda_{2} \cdot h_{2}}{L_{2}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{B} \cdot h_{2}}{h_{2} \cdot \rho_{IIB} + a_{2} \cdot K_{PB} \cdot \rho_{P}}} \end{aligned} \right\} ,$$
(4)

где $\phi_{A} = \vartheta_{1} \cdot (A + \gamma_{1} \cdot \rho_{P})/(A + \rho_{P}),$ $\phi_{B} = \vartheta_{2} \cdot (B + \gamma_{2} \cdot \rho_{P})/(B + \rho_{P})$ температурные коэффициенты частот резонаторов; $A = (h_{1} \cdot \rho_{IIA})/(K_{PA} \cdot a_{1}),$ $B = (h_{2} \cdot \rho_{IIB})/(K_{PB} \cdot a_{2})$ – постоянные резонаторов, которые определяются теоретически на стадии проектирования и уточняются экспериментально после изготовления резонаторов; $\vartheta_{1} = 0, 5 \cdot (\beta_{EA} - \alpha_{1}),$ $\gamma_{1} = (\beta_{EA} + 2 \cdot \alpha_{1} - \beta_{V})/(\beta_{EA} - \alpha_{1}),$ $\vartheta_{2} = 0, 5 \cdot (\beta_{EB} - \alpha_{2}),$ $\gamma_{2} = (\beta_{EB} + 2 \cdot \alpha_{2} - \beta_{V})/(\beta_{EB} - \alpha_{2})$ - температурные постоянные резонаторов.

Приравняв нулю, множитель при Δt в первом уравнении системы (4), для заданной точки $\rho_P = \rho_K$ диапазона контроля плотности, с учётом соотношений для ϕ_A , ϕ_B , $f_1(\rho_P)$, $f_2(\rho_P)$, получим условие инвариантности к колебаниям температуры в виде:

$$\begin{bmatrix} \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}\right)^{2} + 10.92 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{1}^{4}}{a_{1}^{4}} \cdot \frac{a_{1}^{2}}{h_{1}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}\right)^{-2} \\ \frac{1}{\left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{2} + 10.92 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{2}^{4}}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}} \end{bmatrix}^{0.5} \cdot \frac{9_{1}}{\theta_{2}} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{1.5} \cdot \frac{L_{2}^{2}}{L_{1}^{2}} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{1.5} \cdot \frac{L_{2}^{2}}{L_{1}^{2}} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}} - \frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{0.5} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}} - \frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{0.5} \cdot \frac{1}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}} - \frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{0.5} \cdot \frac{h_{1}}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}} - \frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{0.5} \cdot \frac{h_{1}}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}} - \frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{0.5} \cdot \frac{h_{1}}{h_{2}^{2}} \cdot \frac{h_{1}}{h_{2}^{2}}$$

3. Определение условий инвариантности к колебаниям давления контролируемой среды

Влияние внутреннего давления на частоту колебаний цилиндрического резонатора можно учесть воспользовавшись соотношениями для усилий N_Z^1 , N_S^1 , N_Z^2 , N_S^2 , зависящих от внутреннего давления и действующих в осевом и окружном направлении срединной поверхности цилиндра [8].

$$N_{Z}^{1} = 0,5 \cdot \Delta p \cdot a_{1}$$

$$N_{Z}^{2} = 0,5 \cdot \Delta p \cdot a_{2}$$

$$N_{S}^{1} = \Delta p \cdot a_{1},$$

$$N_{S}^{2} = \Delta p \cdot a_{2}$$
(6)

где Δp - перепад давления между наружной и внутренней поверхностями резонаторов.

Подставив систему (6) в систему уравнений (1), учитывая, что $\frac{2,73 \cdot L_1^2}{\pi^2 \cdot \lambda_1^2 \cdot E_A \cdot h_1^3} \cdot \left[\pi^2 \cdot N_Z^1 + 4 \cdot \frac{L_1^2}{a_1^2} \cdot N_S^1 \right] <<1, \qquad , \frac{2,73 \cdot L_2^2}{\pi^2 \cdot \lambda_2^2 \cdot E_B \cdot h_2^3} \cdot \left[\pi^2 \cdot N_Z^2 + 4 \cdot \frac{L_2^2}{a_2^2} \cdot N_S^2 \right] <<1$

получим соотношения для частот резонаторов и датчика в виде:

$$\begin{aligned} & f_{II} = f_{I}(\rho_{P}) - f_{2}(\rho_{P}) - \\ & - \left[f_{I}(\rho_{P}) \cdot \phi_{A} - f_{2}(\rho_{P}) \cdot \phi_{B}\right] \cdot \Delta p \\ & f_{I}(\rho_{P}) = \frac{0.303 \,\lambda_{I} \cdot h_{I}}{L_{I}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{A} \cdot h_{I}}{h_{I} \cdot \rho_{ILA} + a_{I} \cdot K_{PA} \cdot \rho_{P}}} \\ & f_{2}(\rho_{P}) = \frac{0.303 \,\lambda_{2} \cdot h_{2}}{L_{2}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{E_{B} \cdot h_{2}}{h_{2} \cdot \rho_{ILB} + a_{2} \cdot K_{PB} \cdot \rho_{P}}} \end{aligned}$$

$$(7)$$

где

$$\phi_{\rm A} = \frac{1,365 \cdot L_1^2 \cdot a_1}{\pi^2 \cdot \lambda_1^2 \cdot E_{\rm A} \cdot h_1^3} \cdot \left(\frac{\pi^2}{2} + 4 \cdot \frac{L_1^2}{a_1^2}\right), \\ \phi_{\rm B} = \frac{1,365 \cdot L_2^2 \cdot a_2}{\pi^2 \cdot \lambda_2^2 \cdot E_{\rm B} \cdot h_2^3} \cdot \left(\frac{\pi^2}{2} + 4 \cdot \frac{L_2^2}{a_2^2}\right)$$

коэффициенты влияния перепада давлений на частоты цилиндрических резонаторов.

Приравнивая к нулю множитель при Δp в первом уравнении системы (7), с у чётом соотношений для ϕ_A , ϕ_B , $f_1(\rho_P)$, $f_2(\rho_P)$ получим

условия инвариантности датчика к давлению для заданного значения контролируемой плотности $\rho_{\rm K}$ в виде:

$$\frac{\left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{2} + 10,92 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{2}^{4}}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}}{\left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}\right)^{2} + 10,92 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{1}^{4}}{a_{1}^{4}} \cdot \frac{a_{1}^{2}}{h_{1}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}\right)^{-2}} \cdot \frac{E_{B}}{E_{A}} \cdot \left(\frac{h_{2}}{h_{1}}\right)^{3} \cdot \frac{a_{1}}{a_{2}} \cdot \frac{K_{PB}}{K_{PA}} \cdot \frac{(h_{2} \cdot \rho_{IIB})/(K_{PB} \cdot a_{2}) + \rho_{K}}{(h_{1} \cdot \rho_{IIA})/(K_{PA} \cdot a_{1}) + \rho_{K}} = \left(\frac{\pi^{2} + 8 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}}{\pi^{2} + 8 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}}\right)^{2}$$
(8)

Анализ соотношения (8), показывает, что если $\frac{(h_2 \cdot \rho_{IIB})/(K_{PB} \cdot a_2) + \rho_K}{(h_1 \cdot \rho_{IIA})/(K_{PA} \cdot a_1) + \rho_K} = 1$ дифференциальный датчик инвариантен к

изменению давления во всем диапазоне измерения плотности, а само условие (8) распадается на два следующих условия обвиненных в систему:

$$\frac{h_{2} \cdot \rho_{IIB}}{K_{PB} \cdot a_{2}} = \frac{h_{1} \cdot \rho_{IIA}}{K_{PA} \cdot a_{1}}
= \frac{(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2})^{2} + 10,92 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{2}^{4}}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}} \cdot (\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2})^{-2}}{(\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2})^{2} + 10,92 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{1}^{4}}{a_{1}^{4}} \cdot \frac{a_{1}^{2}}{h_{1}^{2}} \cdot (\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2})^{-2}} \cdot \frac{E_{B}}{E_{A}} \cdot \left\{ \cdot \left(\frac{h_{2}}{h_{1}}\right)^{3} \cdot \frac{a_{1}}{a_{2}} \cdot \frac{K_{PB}}{K_{PA}} = \left(\frac{\pi^{2} + 8 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}}{\pi^{2} + 8 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}}\right)^{2} \right\} \right\} . \quad (9)$$

)

4. Определение условий инвариантности к колебаниям температуры и давления контролируемой жидкости

Для обеспечения условий инвариантности датчика к температуре и внутреннему давлению контролируемой среды в цилиндрических резонаторах нужно исследовать возможность совместного решения систем уравнений (5), (9). Подставим соотношения для отношений a_1/a_2 , h_1/a_1 , h_2/h_1 полученных из первого уравнения системы (9) во второе уравнение этой системы, получим:

$$\frac{\left[\left(\pi^{2}+4\cdot L_{2}^{2}/a_{2}^{2}\right)^{2}+1092\cdot\pi^{4}\cdot\frac{L_{2}^{4}}{a_{2}^{4}}\cdot\frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}}\cdot\left(\pi^{2}+4\cdot L_{2}^{2}/a_{2}^{2}\right)^{-2}\right]\cdot E_{B}\cdot a_{2}^{2}\cdot\rho_{ILA}^{3}\cdot K_{PB}^{4}}{\left[\left(\pi^{2}+4\cdot L_{1}^{2}/a_{1}^{2}\right)^{2}+1092\cdot\pi^{4}\cdot\frac{L_{1}^{4}}{a_{1}^{4}}\cdot\frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}}\cdot\left(\frac{\rho_{ILA}}{\rho_{ILB}}\right)^{2}\cdot\left(\frac{K_{PB}}{K_{PA}}\right)^{2}\cdot\left(\pi^{2}+4\cdot L_{1}^{2}/a_{1}^{2}\right)^{-2}\right]\cdot E_{A}\cdot a_{1}^{2}\cdot\rho_{ILB}^{3}\cdot K_{PA}^{4} = .$$
 (10)
$$=\left(\frac{\pi^{2}+8\cdot L_{2}^{2}/a_{2}^{2}}{\pi^{2}+8\cdot L_{1}^{2}/a_{1}^{2}}\right)^{2}$$

Для практического использования соотношения (5) возведём его обе части в квадрат, получим:

$$\frac{\left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}\right)^{2} + 1092 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{1}^{4}}{a_{1}^{4}} \cdot \frac{a_{1}^{2}}{h_{1}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{1}^{2} / a_{1}^{2}\right)^{-2}}{\left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{2} + 1092 \cdot \pi^{4} \cdot \frac{L_{2}^{4}}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}} \cdot \left(\frac{\vartheta_{1}}{\vartheta_{2}}\right)^{2} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{L_{2}}{L_{1}}\right)^{4}}{\left(\frac{L_{2}}{L_{1}}\right)^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}} \cdot \left(\frac{\vartheta_{1}}{\vartheta_{2}}\right)^{2} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{L_{2}}{L_{1}}\right)^{4}}{\left(\frac{L_{2}}{L_{1}}\right)^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{a_{2}^{2}}{h_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}} \cdot \left(\frac{\vartheta_{1}}{\vartheta_{2}}\right)^{2} \cdot \left(\frac{h_{1}}{h_{2}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{L_{2}}{L_{1}}\right)^{4} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}}{\left(\frac{\vartheta_{1}}{\vartheta_{2}}\right)^{2} \cdot \left(\frac{\vartheta_{1}}{h_{2}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{L_{2}}{L_{1}}\right)^{4} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}}{\left(\frac{\vartheta_{1}}{\vartheta_{2}}\right)^{2} \cdot \left(\frac{\vartheta_{1}}{h_{2}}\right)^{3} \cdot \left(\frac{L_{2}}{L_{1}}\right)^{4} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{2}} \cdot \left(\pi^{2} + 4 \cdot L_{2}^{2} / a_{2}^{2}\right)^{-2}}{\left(\frac{\vartheta_{1}}{\vartheta_{2}}\right)^{4} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4}} \cdot \frac{1}{a_{2}^{4$$

5. Вывод вспомогательных соотношений для учёта чувствительности датчика и оценки ожидаемых погрешностей измерения

Определение параметров дифференциального датчика, может быть произведено только с учётом абсолютной чувствительности в точке компенсации $\rho_{\rm K}$, которую определяют для нормальных условий из системы уравнений (1):

$$S_{\mathcal{A}} = \sqrt{\frac{0,0225 \cdot K_{PB}^{2} \cdot a_{2}^{2} \cdot \lambda_{2}^{2} \cdot E_{B} \cdot h_{2}^{3}}{L_{2}^{4} \cdot (\rho_{IIB} \cdot h_{2} + K_{PB} \cdot \rho_{P} \cdot a_{2})^{3}}} - \sqrt{\frac{0,0225 \cdot K_{PA}^{2} \cdot a_{1}^{2} \cdot \lambda_{1}^{2} \cdot E_{A} \cdot h_{1}^{3}}{L_{1}^{4} \cdot (\rho_{IIA} \cdot h_{1} + K_{PA} \cdot \rho_{P} \cdot a_{1})^{3}}}.$$
 (12)

Чувствительность датчика должна составлять не менее 0,5÷ 1 Гц на 1 кг/м³. Для оптимального дифференциального датчика на основе цилиндрических резонаторов параметры резонаторов для последующего расчёта необходимо определять из следующих условий [9]:

$$L_{1} = 5 \cdot 10^{-2} \div 1 \cdot 10^{-1} \text{ M},$$

$$L_{2} = 1 \cdot 10^{-1} \div 5 \cdot 10^{-2} \text{ M}.$$

$$a_{1} = 15 \cdot 10^{-3} \div 20 \cdot 10^{-3} \text{ M},$$

$$a_{2} = 20 \cdot 10^{-3} \div 35 \cdot 10^{-3} \text{ M}.$$
(13)

Полученные в расчётах параметры резонаторов необходимо проверять на условия длинных цилиндров, для которых и получены все приведенные выше соотношения.

$$\begin{bmatrix} \underline{L}_{1} \cdot (\underline{l} - \mu^{2}) \\ (\underline{a}_{1} \cdot \underline{h}_{1})^{2} \end{bmatrix}^{\frac{1}{4}} > 3$$

$$\begin{bmatrix} \underline{L}_{2} \cdot (\underline{l} - \mu^{2}) \\ (\underline{a}_{2} \cdot \underline{h}_{2})^{2} \end{bmatrix}^{\frac{1}{4}} > 3$$
(14)

Распределение вдоль диапазона измерения ожидаемой температурной погрешности находят из соотношения для температурного коэффициента частоты датчика ϕ_{II} , полученного из системы уравнений (4).

$$\phi_{\text{II}} = \frac{\vartheta_{\text{I}} \cdot \frac{\mathbf{A} + \gamma_{\text{I}} \cdot \rho_{\text{P}}}{\mathbf{A} + \rho_{\text{P}}} \cdot \frac{\lambda_{\text{I}}}{\lambda_{2}} \cdot \frac{\mathbf{h}_{1}}{\mathbf{h}_{2}} \cdot \frac{\mathbf{L}_{2}^{2}}{\mathbf{L}_{1}^{2}} \cdot \left(\frac{\mathbf{E}_{\text{A}} \cdot \rho_{\text{IIB}}}{\mathbf{E}_{\text{B}} \cdot \rho_{\text{IIA}}}\right)^{0.5} \cdot \left(\frac{\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \rho_{\text{P}})}{\mathbf{B} \cdot (\mathbf{A} + \rho_{\text{P}})}\right)^{0.5} - \vartheta_{2} \cdot \frac{\mathbf{B} + \gamma_{2} \cdot \rho_{\text{P}}}{\mathbf{B} + \rho_{\text{P}}}}{\frac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}} \cdot \frac{\mathbf{h}_{1}}{\lambda_{2}} \cdot \frac{\mathbf{L}_{2}^{2}}{\mathbf{L}_{1}^{2}} \cdot \left(\frac{\mathbf{E}_{\text{A}} \cdot \rho_{\text{IIB}}}{\mathbf{E}_{\text{B}} \cdot \rho_{\text{IIA}}}\right)^{0.5} \cdot \left(\frac{\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \rho_{\text{P}})}{\mathbf{B} \cdot (\mathbf{A} + \rho_{\text{P}})}\right)^{0.5} - 1$$
(15)

Проверить влияние перепада давления ∆р на выходной частотный сигнал датчика можно при помощи соотношения для коэффициента, $\phi_{\mathcal{I}}$ полученного из системы уравнений (7).

$$\phi_{II} = \frac{f_{01} \cdot [A(A+\rho_{P})]^{0.5} \cdot \frac{I_{3}^{2} 6 \mathfrak{A}_{1}^{2} \cdot a_{I}}{\pi^{2} \cdot \lambda_{1}^{2} \cdot E_{A} \cdot h_{I}^{3}} \cdot \left(\frac{\pi^{2}}{2} + 4 \cdot \frac{L_{1}^{2}}{a_{1}^{2}}\right) - f_{02} \cdot [B(B+\rho_{P})]^{0.5} \cdot \frac{I_{3}^{2} 6 \mathfrak{A}_{2}^{2} \cdot a_{2}}{\pi^{2} \cdot \lambda_{2}^{2} \cdot E_{B} \cdot h_{2}^{3}} \cdot \left(\frac{\pi^{2}}{2} + 4 \cdot \frac{L_{2}^{2}}{a_{2}^{2}}\right)}{f_{01} \cdot [A(A+\rho_{P})]^{0.5} - f_{02} \cdot [B(B+\rho_{P})]^{0.5}}.$$
 (16)

Градировочную характеристику датчика для нормальных условий можно получить из (4) или (7) приняв соответственно $\Delta t = 0$ или $\Delta p = 0$.

$$\begin{split} \mathbf{f}_{\mathcal{A}} &= \mathbf{f}_{01} \cdot \left[\mathbf{A} / \left(\mathbf{A} + \boldsymbol{\rho}_{P} \right) \right]^{0.5} - \mathbf{f}_{02} \cdot \left[\mathbf{B} / \left(\mathbf{B} + \boldsymbol{\rho}_{P} \right) \right]^{0.5}, \quad (17) \\ \text{где} \quad \mathbf{f}_{01} &= \frac{0,303 \cdot \lambda_{1} \cdot \mathbf{h}_{1}}{L_{1}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{\mathbf{E}_{A}}{\boldsymbol{\rho}_{IIA}}}, \\ \mathbf{f}_{02} &= \frac{0,303 \cdot \lambda_{2} \cdot \mathbf{h}_{2}}{L_{2}^{2}} \cdot \sqrt{\frac{\mathbf{E}_{B}}{\boldsymbol{\rho}_{IIB}}} \quad \text{- начальные} \\ \text{частоты цилиндрических резонаторов;} \quad \mathbf{A} &= \left(\mathbf{h}_{1} \cdot \boldsymbol{\rho}_{IIA} \right) / \left(\mathbf{K}_{PA} \cdot \mathbf{a}_{1} \right), \\ \mathbf{B} &= \left(\mathbf{h}_{2} \cdot \boldsymbol{\rho}_{IIB} \right) / \left(\mathbf{K}_{PB} \cdot \mathbf{a}_{2} \right) \text{- постоянные цилиндрических резонаторов.} \end{split}$$

6. Пример расчёта параметров цилиндрических резонаторов дифференциального датчика вибрационного плотномера

По рекомендациям, приведенным в работе. [9], выбираем резонаторы из нержавеющих сталей марок X17H2T, X18H10T. Для выбранных сталей резонаторы имеют следующие параметры: $E_A = 210 \cdot 10^9 \, \text{m/m}^2$, $B_B = 196 \cdot 10^9 \, \text{m/m}^2$, $\beta_{EA} = 3,1 \cdot 10^{-4} 1^{\circ} \text{C}$, $\beta_{EB} = 4,4 \cdot 10^{-4} 1^{\circ} \text{C}$, $\alpha_1 = 10,3 \cdot 10^{-6} 1^{\circ} \text{C}$, $\alpha_2 = 16,2 \cdot 10^{-6} 1^{\circ} \text{C}$, $\rho_{TA} = 7750 \, \text{кг} / \, \text{m}^3$, $\rho_{TB} = 7900 \, \text{кг} / \, \text{m}^3$, $\vartheta_1 = 1,498 \cdot 10^{-4}$, $\vartheta_2 = 2,119 \cdot 10^{-4}$.

Параметры контролируемой жидкости (светлые нефтепродукты): $\rho_{_{MIH}} = 650\,{\rm kr}\,/\,{\rm m}^3~\rho_{_{Mak}} = 850\,{\rm kr}\,/\,{\rm m}^3~\rho_{_{\rm K}} = 750\,{\rm kr}\,/\,{\rm m}^3$, $p = 0,5 \div 1~M\Pi a$, $\beta_{_{\rm V}} = 1\cdot 10^{-3}1/^{\circ}C$, $t = 20 \div 60^{\circ}C$, $\gamma_1 = -2,234$, $\gamma_2 = -1,245$.

Конструктивные параметры цилиндрических резонаторов принимаемые в расчёте составляют $a_1 = 20,1 \cdot 10^{-3} \text{ м}$, $a_2 = 29,3 \cdot 10^{-3} \text{ м}$, $L_1 = 5,1 \cdot 10^{-2} \text{ м}$, $L_2 = 10,2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$. Приняв $K_{PA} = K_{PB} = 0,22$, из соотношения (10) численным методом определяем $h_2 = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ м}$, а затем из первого уравнения системы (9), получим $h_1 = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ м}$.

Из уравнения (11) уточняем значение плотности жидкости, при которой осуществляться полная компенсация температурной погрешности $\rho_{\rm K} = 760 \, {\rm kr} \, / \, {\rm m}^3$, что обеспечивает снижение погрешности во всём диапазоне более чем на порядок в сравнении с одиночным резонатором.

С учётом полученных конструктивных параметров цилиндрических резонаторов вычисляем величины входящие в соотношение (17) $f_{01} = 12680 \,\Gamma\mu$, $f_{02} = 5572 \,\Gamma\mu$, $A = 2799 \,\kappa\Gamma/M^3$, $B = 2746 \,\kappa\Gamma/M^3$. Чувствительность к плотности по соотношению (12) составляет $S_{\rm A} = -0,88 \,\Gamma\mu/(\kappa\Gamma/M^3)$, что вполне достаточно при работе с персональным компьютером и программных обеспечением виртуального частотомера LabView.

После расчёта с помощью соотношений (15), (16) стоятся графики распределения погрешностей измерения датчика и составляющих резонаторов. Погрешности датчика должны быть более чем на порядок меньше погрешностей резонаторов во всём диапазоне измерения.

Используя описанный в работе [10] испытательный стенд, экспериментально получены уточнённые значения параметров: $f_{01} = 12683 \,\Gamma\mu$, $f_{02} = 5568 \,\Gamma\mu$, $A = 2801 \,\kappa\Gamma/m^3$, $B = 2750 \,\kappa\Gamma/m^3$. Перепад давления жидкости между наружной и внутренней поверхностью резонаторов изменялся в пределах $\Delta p = 0 \div 0,5 \, M\Pi a$, а температура $\Delta t = 20 \div 60 \,^{\circ}C$, плотность жидкости изменялась от $650 \,\kappa\Gamma/m^3$ до $850 \,\kappa\Gamma/m^3$ с шагом $\Delta \rho = 20 \,\kappa\Gamma/m^3$. Результаты расчётов $\phi_A, \phi_B, \phi_{\Pi}, \phi_{\Pi}$, проведенные по данным замеров приведены на рисунке.



Рисунок 1 - Распределение вдоль диапазона контроля плотности, дополнительных погрешностей от изменения температуры и давления:

1 — температурній коэффициент $\phi_{\pi}[1/^{\circ}C]$ частоти датчика; 2 — коэффициент влияния давления $\psi_{\pi}[1/H]$ на частоту датчика; 3,4 —

температурные коэффициенты $\phi_A[1/^\circ C]$, $\phi_B[1/^\circ C]$ частоты составляющих резонаторов.

Из приведенных данных следует, что температурная погрешность датчика плотности с цилиндрическими резонаторами на порядок меньше меньшей из погрешностей резонаторов. При этом датчик практически инвариантен к колебаниям температуры и давления контролируемой среды.

Расширить возможности спроектированного по предложенной методике плотномера можно путем управления частотами составляющих резонаторов [11].

Выводы:

• Приведенная методика расчёта основных конструктивных параметров датчика вибрационного плотномера, в котором используются цилиндрические резонаторы, позволяет расширить область применения относительно простых по конструкции и высокоточных вибрационных плотномеров на объекты с резкими колебаниями температуры и давления, например магистральные нефтепроводы и газопроводы;

 Без инерционная компенсация перепада давления между наружной и внутренней поверхностью цилиндра позволяет исключить подачу контролируемой среды на наружную поверхность цилиндров, а следовательно исключить демпфирование колебаний цилиндра контролируемой средой в зазоре между наружной поверхностью и системой возбуждения колебаний цилиндра;

• В перспективе автором будет изучена возможность одновременного возбуждения автоколебаний цилиндра на различных не зависимых пространственных формах.

Список литературы: 1. Кивилис С.С. Плотномеры. — М.: Энергия, 1980. -280 С. 2. Эткин Л. Г. Виброчастотные датчики. Теория и практика. — М.:Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. — 408 с. З. Жуков Ю.П. Вибрационные плотномеры. – М.: Энергоатомиздат, 1991. - 144 с. 4. Пат.1175586 Англия, МКИ G01 n 9/00, Measuring of fluid density/ J. Agar/ 1968 5. A.c. 1291867 СССР, МКИ G01N 29/00. Способ дифференциального измерения плотности/ Тараненко Ю.К. -Опубл. 23.02. 87, Бюл. № 7. 6. Тараненко Ю.К. Математична модель вимірювального перетворення щільності рідини у частотний вихідний сигнал диференційного датчика на основі двох циліндричних резонаторів /Ю.К.Тараненко//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2006. —6/2(24). —С.77 -83 7. Буйвол В.Н. Колебания и устойчивость деформируемых систем в жидкости. К.: Наук. думка, 1975. - 356 с. 8. Горенштейн И.А. Гидростатические частотные датчики первичной информации. М., «Машиностроение» 1976, 184 с. 9. Тараненко Ю.К. Методика проектування оптимальних диференційних датчиків щільності рідини та концентрації дисперсних систем/ // Вопр. химии та хим. технологии.— 2006. — № 4. — С. 211-214 10. Тараненко Ю.К. Градуювання та повірка поточних віброчастотних вимірювачів шільності з диференційним датчиком //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2007. —2/2(26). —C.41 -47 11. Дифференциальный вибрационный плотномер: А.с. 1392451 СССР МКИ G01N 9/00/ Ю.К.Тараненко, В.И. Снегур, М.В.Кулаков, И.В. Кораблёв (СССР) №3911436/31-25; Заявлено 10.06.85; Опубл. 30.04.88. Бюл. №16 4 с.